

P-137

宇宙科学シンポジウム 2018/1/9-10 @宇宙科学研究所相模原キャンパス

### サブ秒角でX線天体を撮影する多重像X線干渉計MIXIM (1) 概念検討

林田 清、川端智樹、花坂剛史、朝倉一統、中嶋 大、松本浩典、井上翔太、常深 博(大阪大学理)

| 我々は、光学系を用いない新しいタイプのX 線撮像計、干渉計を提案している。構造は、規則的な周期の格子とX 線分光撮像検出器を組あわせた単純な形式で、天体| からやってくる準平行光が格子を透過してつくる像を撮影する。像は格子と同じ周期をもつので、それを解析で重ね合わせることでX線天体のプロファイルが測定でき る。格子が十分な厚みがあればどのような波長のX線も利用できる。これをX線多重像撮像計(Multi Image X-ray Interferometer Module (Mission):MIXIM)と呼ぶことに する。ただし、回折が効く場合にはそれにより像が広がる。ところが、格子から特定の距離で光子の干渉自己像ができるというタルボ効果を利用すると、回析が効く場 合でも格子の像を得ることができる。自己像ができる距離は、格子の周期をdとしてX線の波長をλすると、 d<sup>2</sup>/λの整数倍である。検出器の位置を固定した場合、特定の 波長のX線だけ選別する必要があるが、それが可能であれば単純な構造の干渉計として働く。これをX線多重像干渉計と呼んでいる。5um ピッチ、開口率0.2の回折格子 を使い、0.1nm(12keV)のX 線を対象とすると、第二周期の像ができる距離は50cm、自己像の幅は0.4 秒角に対応する。パラメータ最適化でChandra 衛星を超える角度 分解能を小型衛星で実現できる可能性もある。いずれの場合にも、集光はしないのでコリメータが必要で、対象も明るい天体に限られるが、超小型衛星でも成果が見込 める。干渉計の場合、自己像のプロファイルを得るためには特定の波長の周囲どのくらいのバンド幅を使用できるかという問題もある。フレネル回析の計算で検討を行 い、厳密な自己像ではなく格子幅程度のプロファイルを得ることを目標にすれば、10%のバンド幅は利用できる。近傍AGNのトーラスのX線空間分解などが期待できる。

## X線天文衛星の観測装置

視野絞りor望遠鏡	検出器 位置検出	視野	角度分解能	ぎんが 1987-19
コリメータ(ぎんが LAC等)	無	1~10度	1~10度	
2枚すだれ (ようこうHXT)	無	~0.5度	~5秒角	
1枚すだれ <b>(Kotoku+2003)</b>	1次元	基礎実験		MAXI 2009-
コーディッドマスク(SwiftBAT の例)	<b>2</b> 次元	~70度	17分角	
スリット <b>(MAXI</b> の例)	<b>2</b> 次元	~90度	~0.1度	
斜入射反射鏡	あり	0.1~1度	0.5秒角~2分角	

秒角、サブ秒角の天文観測

天体の距離、サイズとみかけの視半径



Angular Resolution





• 高い角度分解能を達成するためにはX線反射望遠鏡搭載の巨大衛星が必要 • Chandra衛星の角度分解能0.5秒角を再現する/超えるのは非常に難しい

Multi Image X-ray Interferometer Module/Mission X線多重像干涉計(MIXIM)



- わせるだけ。

## タルボ距離における自己像



## 角度分解能の皮算用

Hayashida+2016SPIE Proc.

 ・像幅を角度分解能Δθとすると0.4"で、Chandra衛 星(焦点距離10m)を超える • c.f. ひとみ衛星は100''、2028年打ちあげのATHENAで

観測対象、特に近傍AGNのトーラスのX線空間分解+偏光測定

MIXIM Targets : Detailed Structure of Bright (>~mCrab) Point-like Sources, i.e., (SM)BHs and NSs

#### **Recoiled SMBH** candidates



(X-ray: NASA/CXC/NRAO/D.-C.Kim; Optical: NASA/STScl)

#### Torus Type2 and Type 1 AGNs



# **Binary SMBHs** Chandra VGC6240

#### NASA/CXC/MPE/S.Komossa et al.



MIXIM-Sモジュール for 超小型衛星

可視光遮断

フィルタ、

コリメータ

マスク

多重化コード化

#### ~500mm CPU 目標: 近傍超巨大BHトーラスのX線空間分解→統一モデルの直接検証 X線画像、偏光マップ トーラス想像図 濃淡はX線強度の強さ ⇔はX線偏光の方向と偏光度の強さ

CMOS検出器

アクティブシールド(シ APD



**Power Supply** 

Driver &

Data Processor

	WISSION Size	Sampler	Snort	Tall	Grande			
	Distance z	0.5m	0.5m	2m	10m			
	Pitch d	25µm	5µm	10µm	10µm			
	Open. Frac. <i>f</i>	0.2	0.2	0.2	0.1(1Dor2 D)			
	Talbot Order <i>m</i> for 0.1nm X-ray	(0.1)	2	2	10			
	$oldsymbol{ heta}$	2''	0.4''	0.2''	0.02''			
	$\Delta\lambda/\lambda$	1	0.2	0.2	0.2			
	No. of X+Y unit ( <i>Ageo</i> =10cm <sup>2</sup> /unit assumed)	1+1	4+4	25+25	500(for2D 100+100(for1D)			
	$\eta_{det}$ at 10keV (200um Si assuemd)	0.78	0.78	0.78	0.78			
	Effective Area	3cm <sup>2</sup>	2.5cm <sup>2</sup>	16cm <sup>2</sup>	7cm <sup>2(2D)</sup> 31cm <sup>2(1D)</sup>			
	1Crab source 1	c/s/cm²/5-20	)keV 1mCra	bx50ksx3cr	n² ~150c/day			
	偏光測定optionも検討中							

参考文献 Hayashida et al. 2016, SPIE proc. 9905, 990557

Hayashida et al. 2017, X-ray Universe2017